|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **买方名称** | **交货地点** | **交货期** | **技术规格** |
| 1 | 大口径激光干涉仪 | 1套 | 中国科学院光电技术研究所 | 中国四川省成都双流西航港光电大道1号 | 合同签订后6个月内 | 见本章 |

**技术规格**

**一、设备名称、数量及用途：**

1.1 设备名称：大口径激光干涉仪

1.2 数量：1套

1.3 设备用途：用于平面、球面元件的面形干涉测量。

**二、工作条件：**

2.1 温度：15℃～30℃。

2.2 相对湿度：40%～70%RH。

2.3 地基条件：工业地基，如对隔振有特殊要求，请注明。

2.4 供电：220V或380V/50Hz。

2.5 配置符合中国相关标准的插头，如有特殊要求，需提供相应的转换插头。

**三、技术要求**

**3.1 测量系统：**

3.1.1 可检测口径：≥4英寸。

3.1.2 配备稳频He-Ne激光，工作波长633nm。

★3.1.3 用波长调制原理测量，可同时测量平面多个表面，具备一次测量就可实现平行平板上下两个面的面形同时检测的能力，最小可测量样品光学厚度≤0.6mm；

3.1.4 配备标准透射平面镜1个，镀动态自适应膜（PVr值：优于λ/50；可接受被测件反射率4%-90%）。

★3.1.5 相机分辨率：≥3000×3000 @4英寸口径。

★3.1.6 系统帧速：≥60Hz （@4英寸口径CCD像素分辨率：≥3000×3000）。

3.1.7 光瞳调焦范围：±2m。

3.1.8 视场范围：≥±2度。

★3.1.9 RMS重复精度（均值2σ）：≤0.35nm。（测量方法为以36次连续测量（每次做16次平均）为基础数据，其中每个奇数项依次减去合成的参考波前（所有偶数项的平均波前），得到的RMS的平均值加上RMS的两倍标准偏差）。

★3.1.10 面形像素峰值偏差：≤0.5nm。（测量方法为：36次连续测量（每次做16次平均）的第99.5个百分位的单像素标准偏差）。

**3.2 软件分析系统：**

3.2.1 具有自主研发的测试分析软件，适用于Windows操作系统。

3.2.2 可显示样品的二维、三维图像。

3.2.3 软件可提供矩形、椭圆、正方形、圆、多边形等形态的数据剪辑功能。

3.2.4 可实现自主编辑函数或算法嵌入功能。

3.2.6 软件可分析计算36项Zernike系数、峰—谷值、标准偏差等。

3.2.7 具备子孔径划分及数据分析功能。

3.2.8 设备及软件的所有功能均可在不需要连接互联网的情况下正常使用。

**四、产品配置要求**

4.1 波长调制激光干涉仪4寸口径主机：1台

4.2 高精度标准透射平面镜镀自适应膜PVr值：优于λ/50；可接受被测件反射率4%-90% （包含出厂测试报告）：1套。

4.3 控制手柄：1个

**4.4 系统和应用软件：**

4.4.1 系统软件备份，存放于CD上：3套

4.4.2 离机分析软件和授权Usbkey（授权有效期≥20年）：1套

**4.8 文档资料：**

4.8.1 参考资料：安装调试指南、设备操作和维护手册、操作软件使用指南：3套。

4.8.2 出厂测试报告：3份。